

(19)
(12)

(KR)
(A)

(51) 。 Int. Cl. ⁷
G02F 1/13

(11)
(43)

2001 - 0083632
2001 09 01

(21)
(22)

10 - 2000 - 0007614
2000 02 17

(71)

20

(72)

1 882 - 1

(74)

:

(54)

가

, 590mm × 670mm

가

20

4

1

2

3

4

5a	1	,
5b	1	,
6a	2	,
6b	2	,
7a	3	,
7b	3	,
8a	4	,
8b	4	.

< >

P1 : 1 P2 : 2
P3 : 3 P4 : 4
P5 : 5 P6 : 6

(photo mask) ,

(common electrode) (switching device) (array line) ,
(colorfilter)가 ,
(gap) , (LC) .

가 ,

가 .

, , , . , , ,

(deposition) , (photo - l i t h o graphy) , (etching)

5000 model) , (photo mask) , (canon aligner : MPA (exposure)

key) . (align

(plate key) . (align key) ,

(sensing) .

(emulsion), ,

가 .

가

(

misalign) .

1 . (17) 가 390mm × 610mm (17) ,

330mm × 560mm (P1,P2,P3) 가

(scanner type) (cannon aligner type system)

가 가 , 20 .

2 .

가 , (MPA5000 model) 가 670mm × 590mm

mm × 560mm 1 (A) 가 670

3 .

(31) (plate key : P1,P2,P3) ,

(31) .

3) (P) () (P) (P1,P2,P

(P1,P2,P3)()가 .

가 , (P)

(P) (mask blade) (33) (35)

(33) (35)

20 18 가 2

가

20

가 590mm × 670mm

3

20mm

가

20mm

가 670mm × 590mm

4

20mm (101) P1, P2, P3

P4, P5, P6

(101)

4

4

, 가

670mm × 590mm

가 .

5a

1

5a

, 1 (119) (B) X (115) Y (B) (117) 220mm 가
 , (B) (117) , X (115) (F) ,
 , Y (117) , 가 (119) , () .
 가 (119)

, (119) (F) 220mm (119) (E)
 (B)

5b

1

(121)

(119)

, (B) , (121) P4,P5,P6
 P1,P2,P3 (121) (119)
 , (121) (119) (,
 P4 P1) ,

1

, 2

가

,

(119)

6a

2

, 2

(C)

(C)

X (115) Y (117)

, Y

(117)

(119)

(F)

220mm

5a

(D)

6b

2

(121)

(119)

(119) (121) , 5b , (121) P1, P2,
 P3 (121) P4, P5, P6 , (C)

7a

3

3 (D) (121) (D) . X - Y (115)(117)
(D) .

, Y (117) (F) 220mm (C) , X (1
15) (B) (E) .

, () (119) .

7b 3 (121) (119) .

, (121) P1,P2,P3 (121) P1,
P2,P3가 , (D) .

8a 4 .

4 (E) . 가 X - Y

, Y (117) (F) 220mm (B) , X (
115) (C,D) .

, () (119) .

8b 4 (121) (119) .

, (121) P1,P2,P3 (119) P1,
P2,P3가 , (121) (E) .

, 가 . , .

, , 4 , 가 670mm × 590mm
, 20 가 ,

(57)

1.

,

;

2.

1 ,

가 가 670mm × 590mm .

3.

1 ,

, 3 .

4.

1 ,

20mm

5.

;

;

;

가

;

.

6.

5 ,

가 ,

.

7.

5 ,

20mm

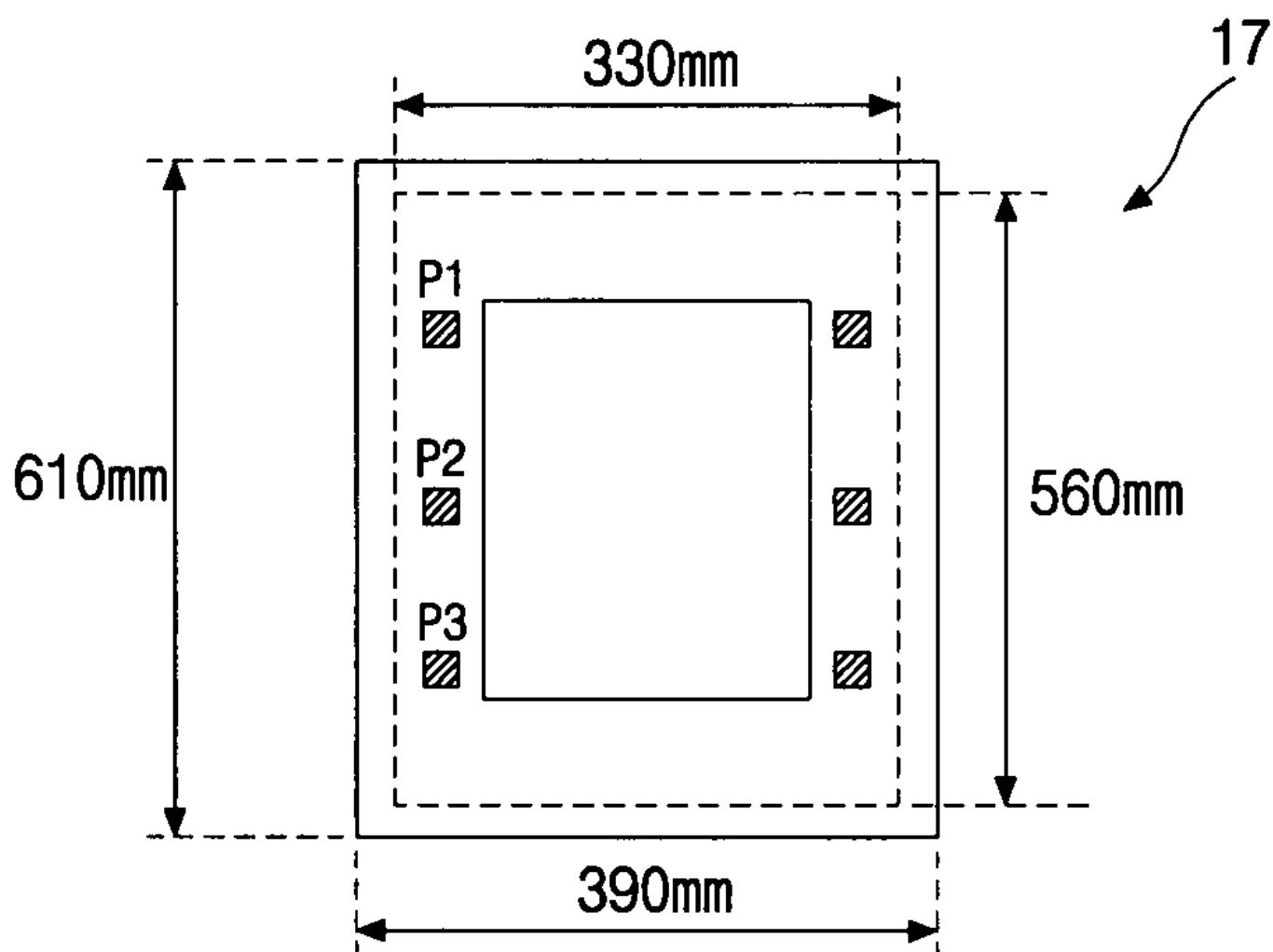
.

8.

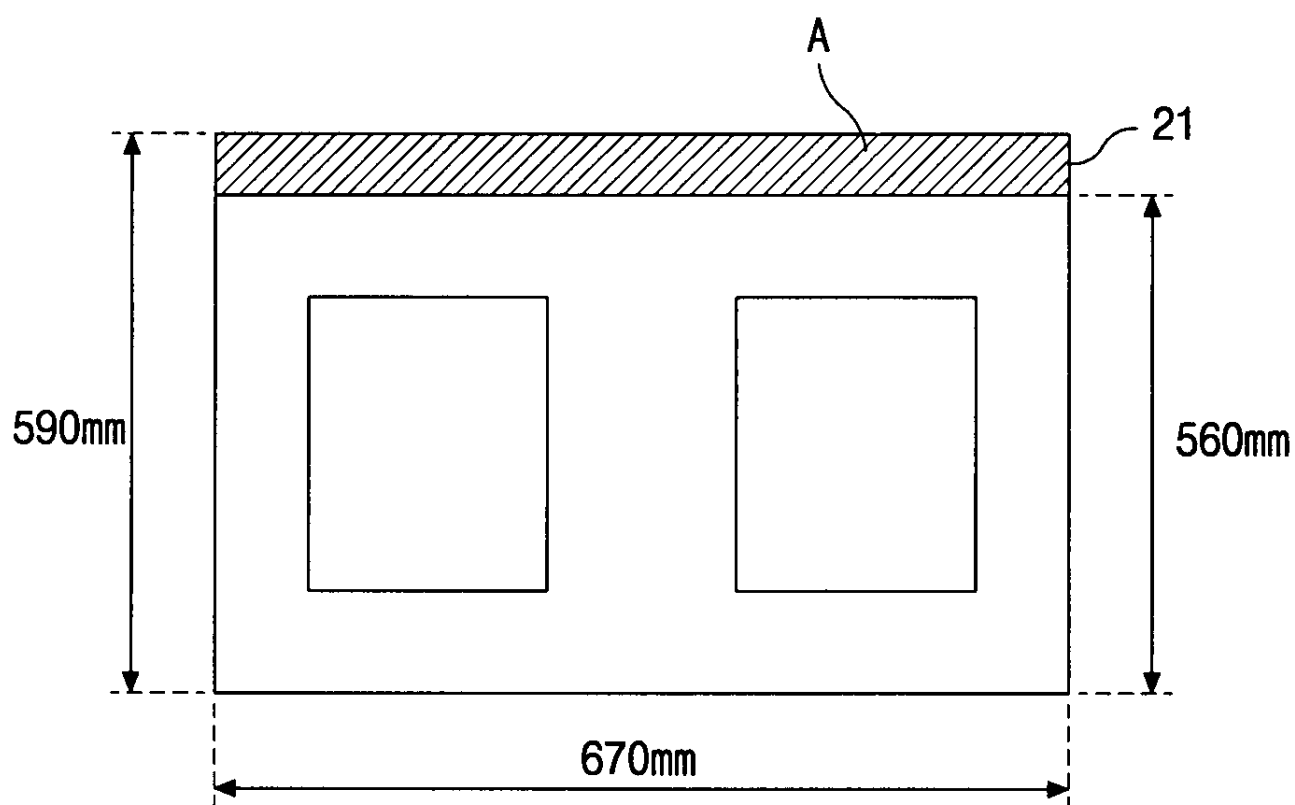
5 ,

가 670mm × 590mm .

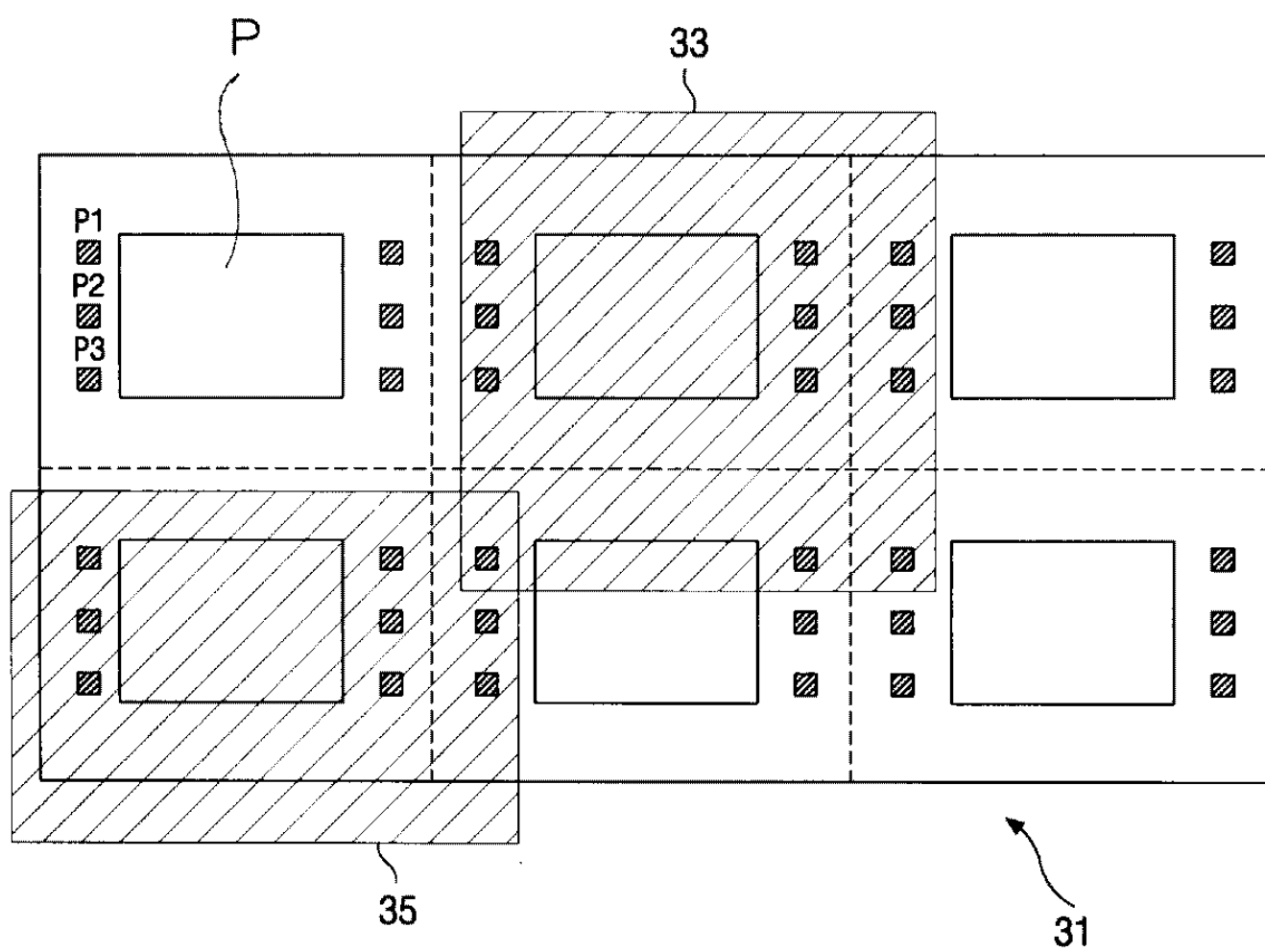
1

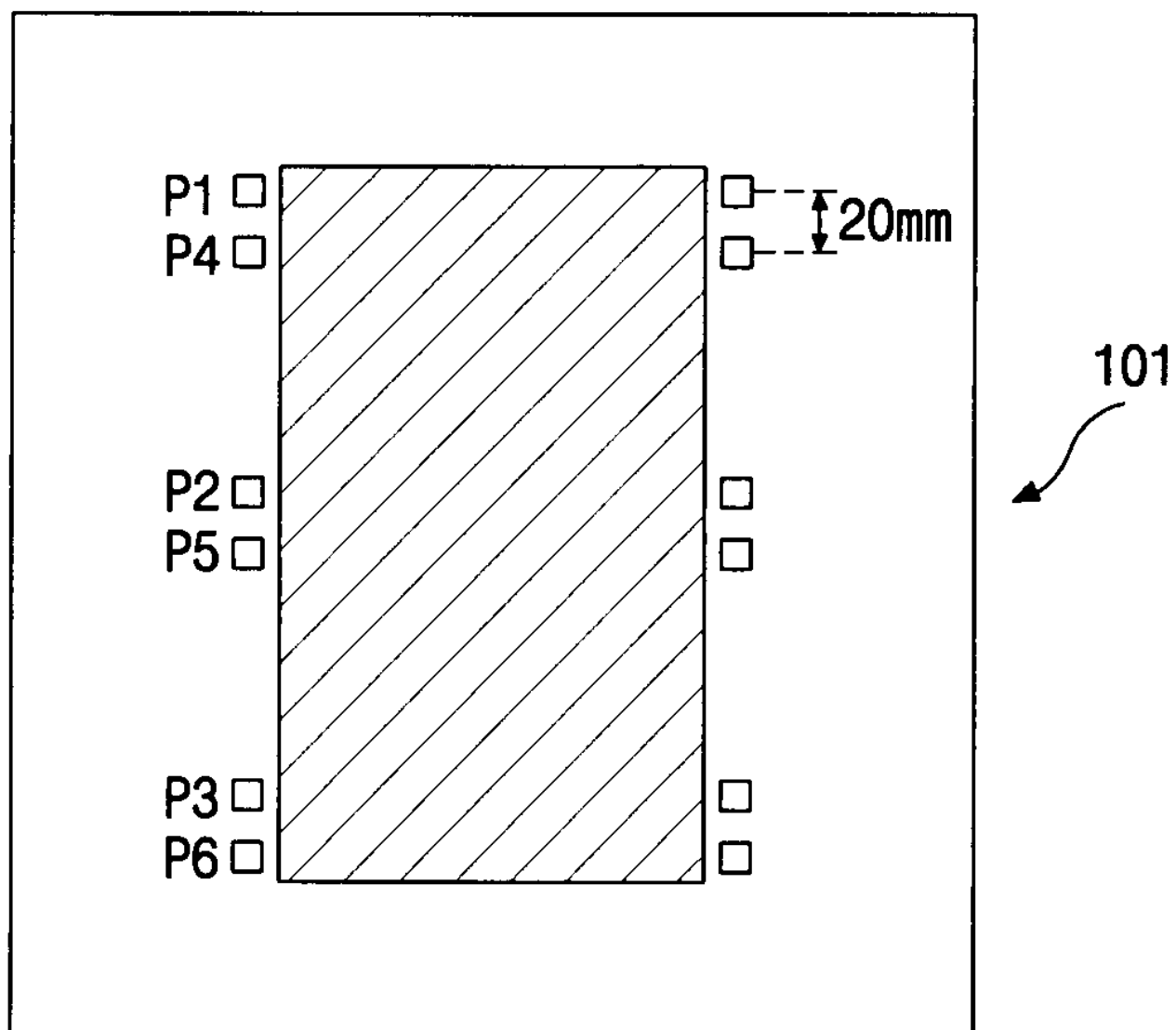


2

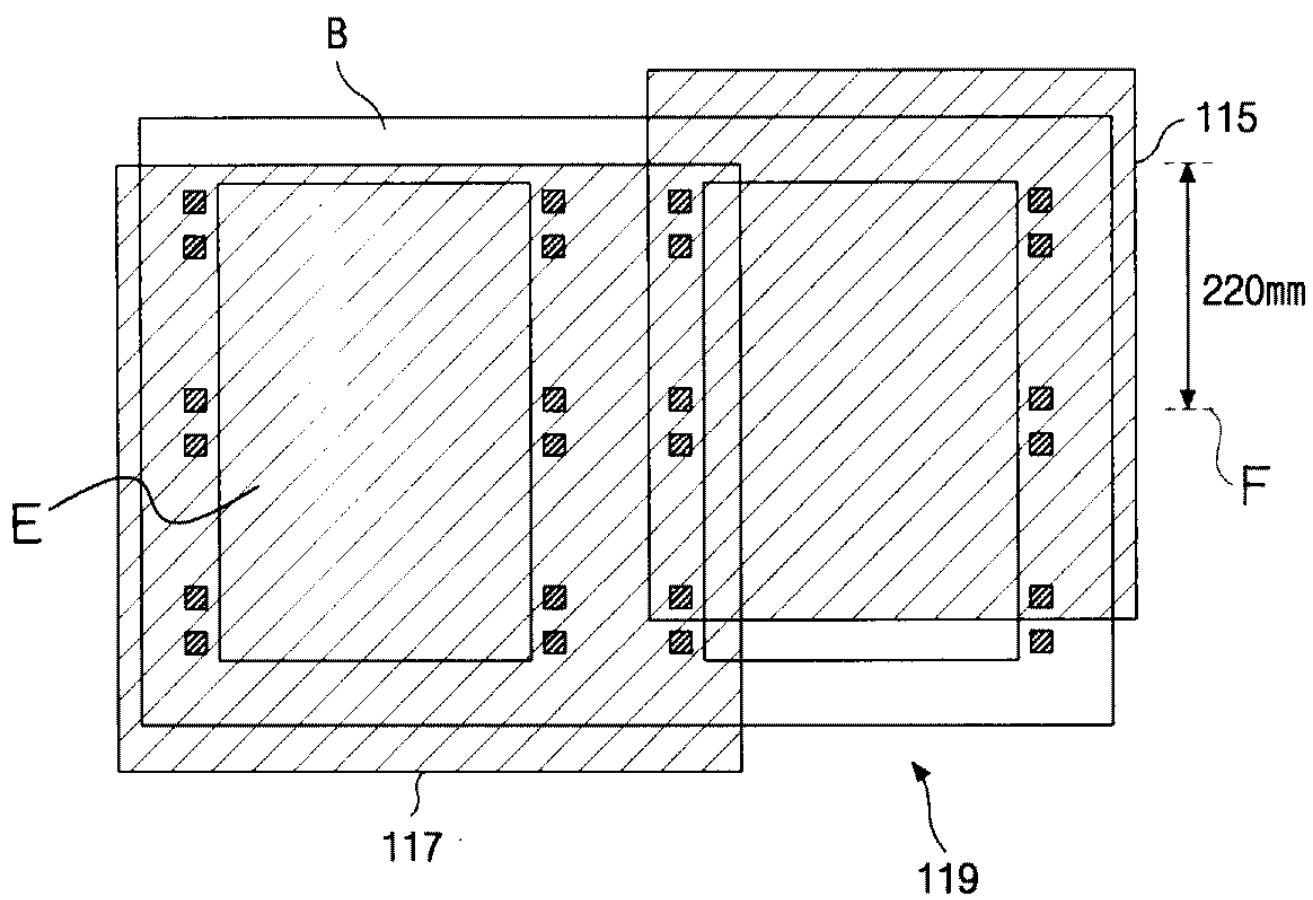


3

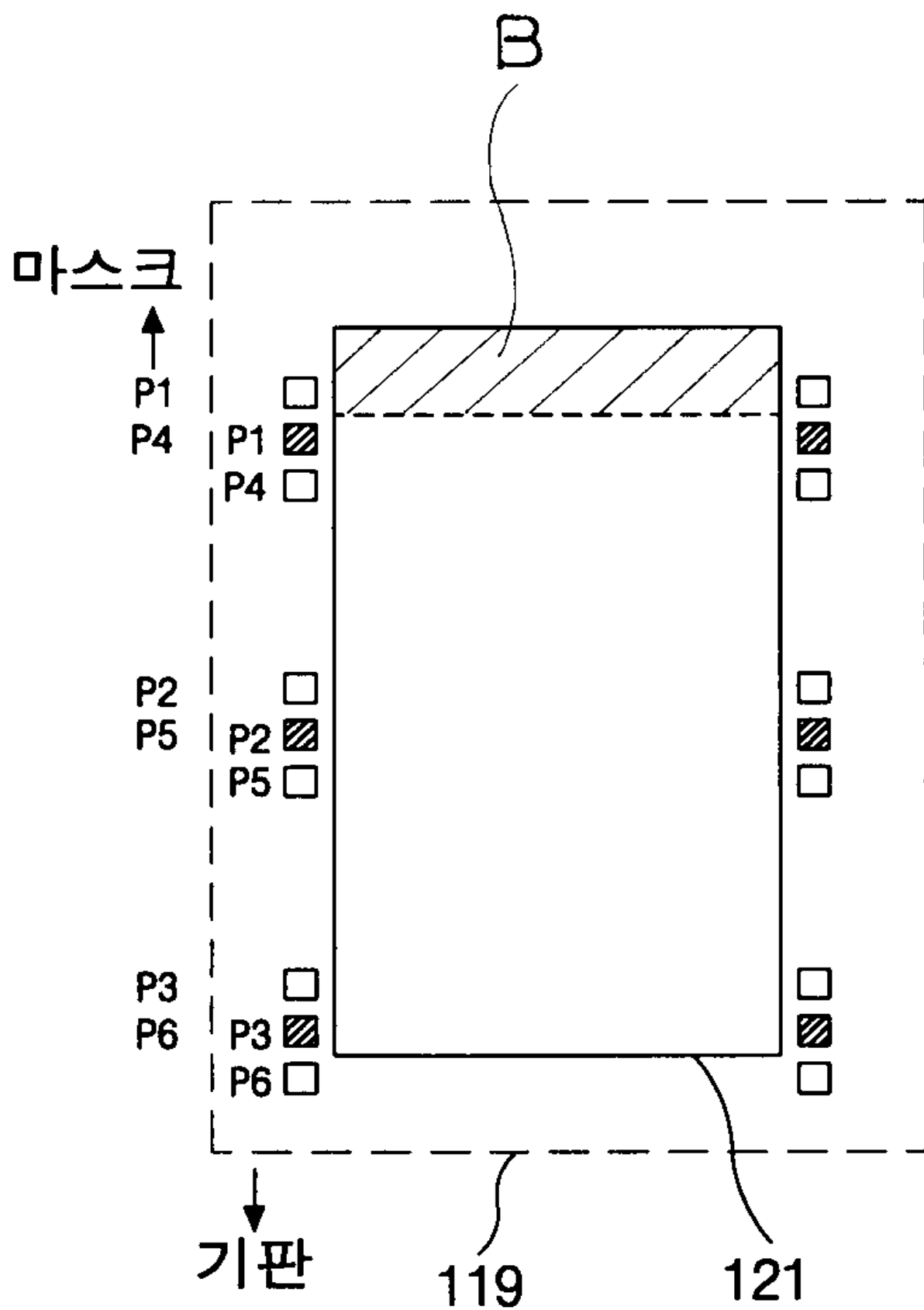




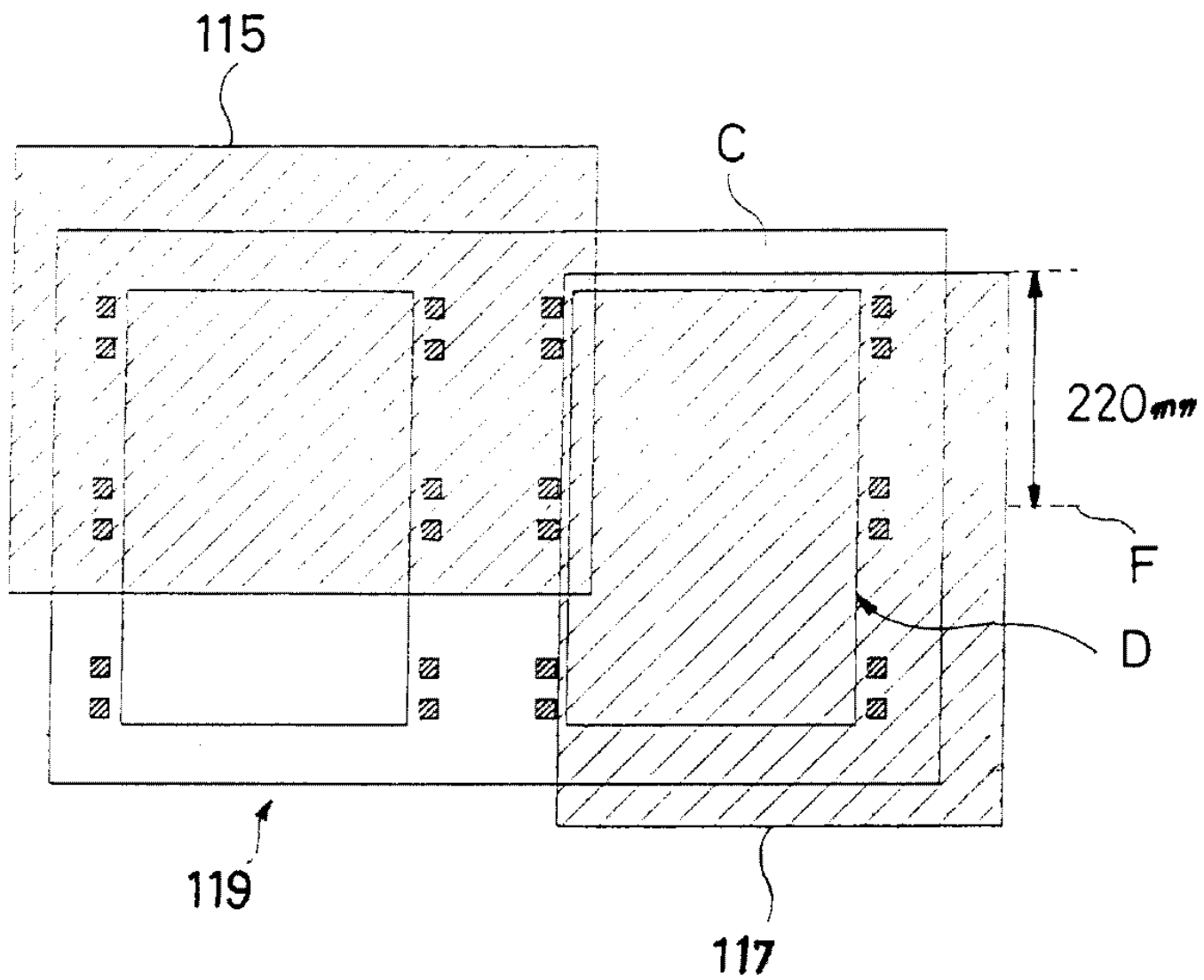
5a



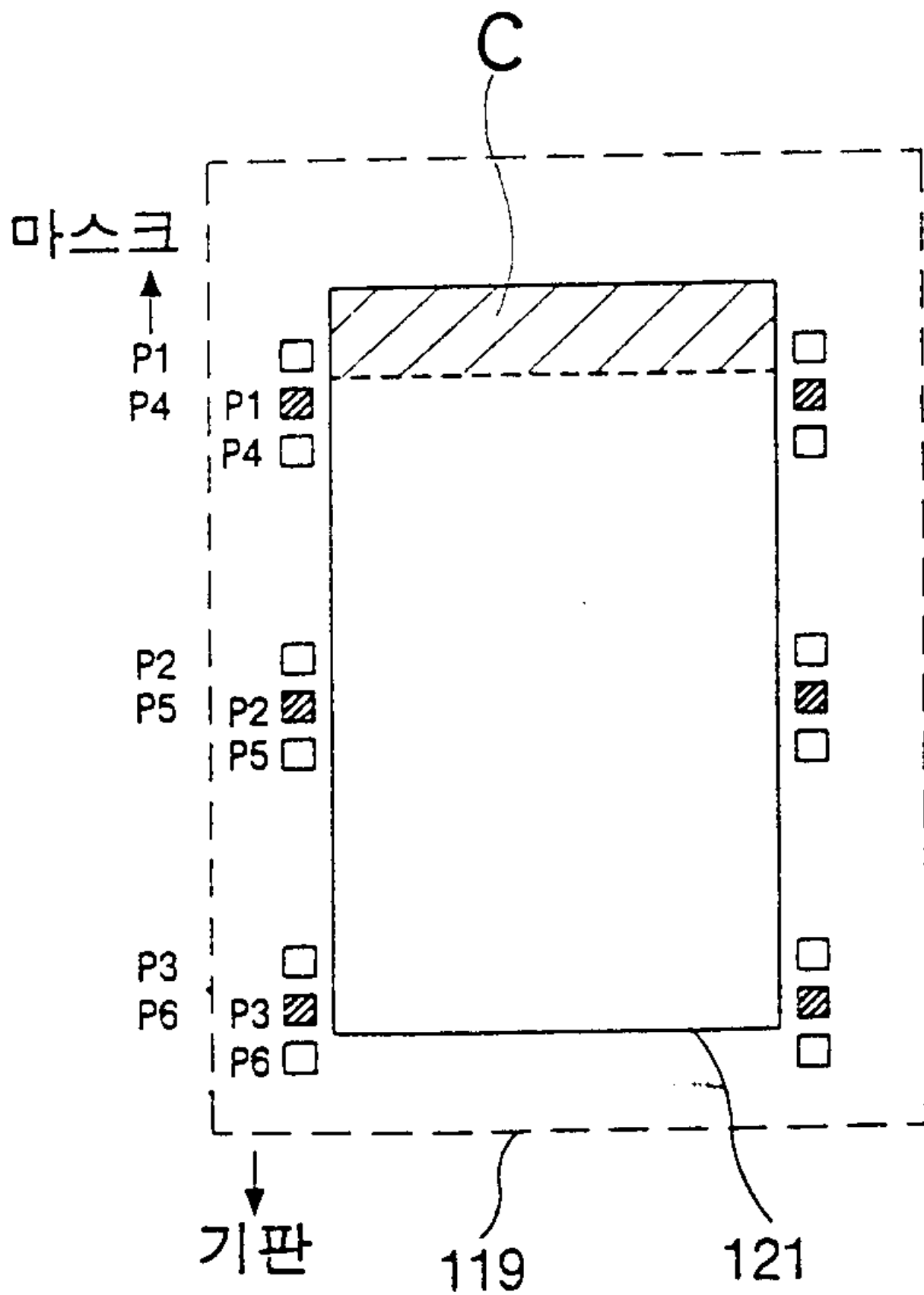
5b



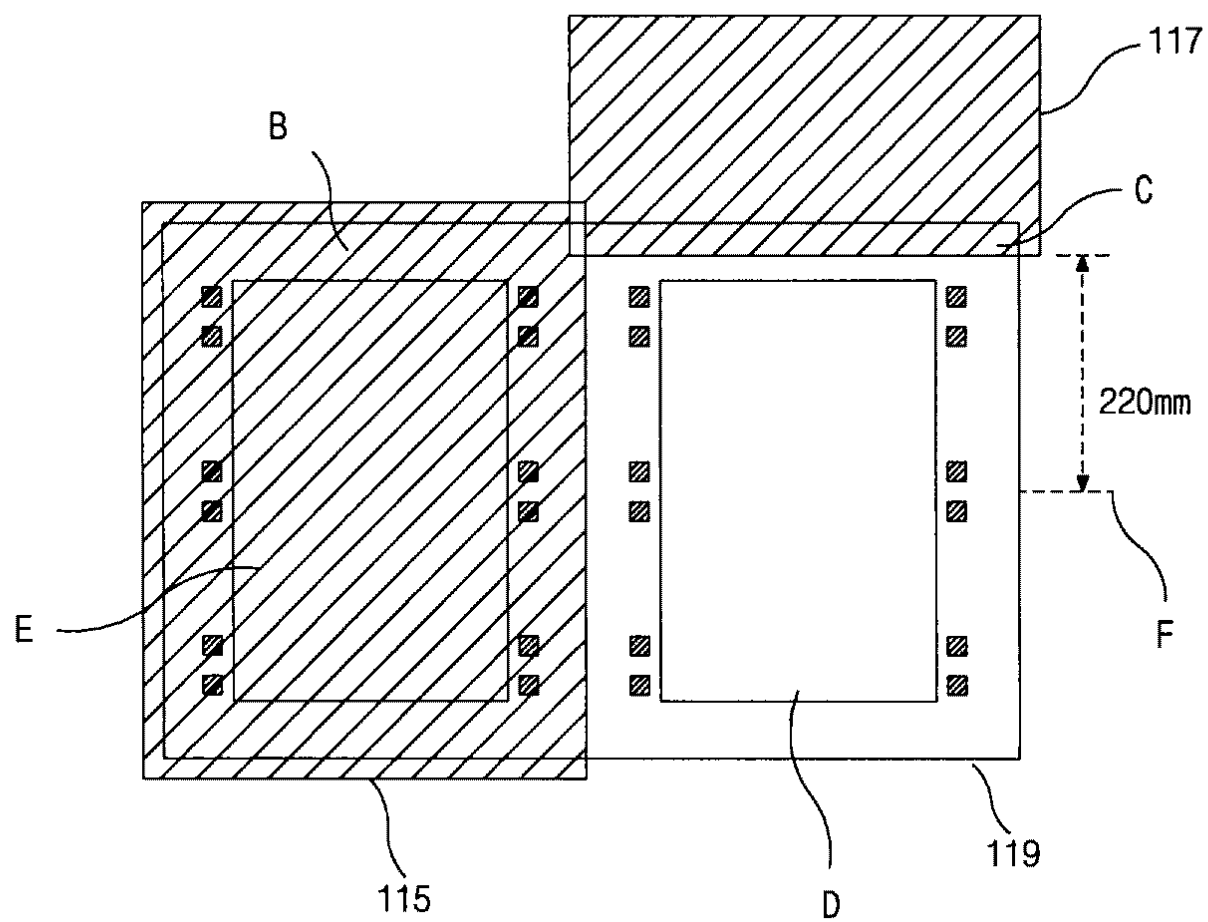
6a



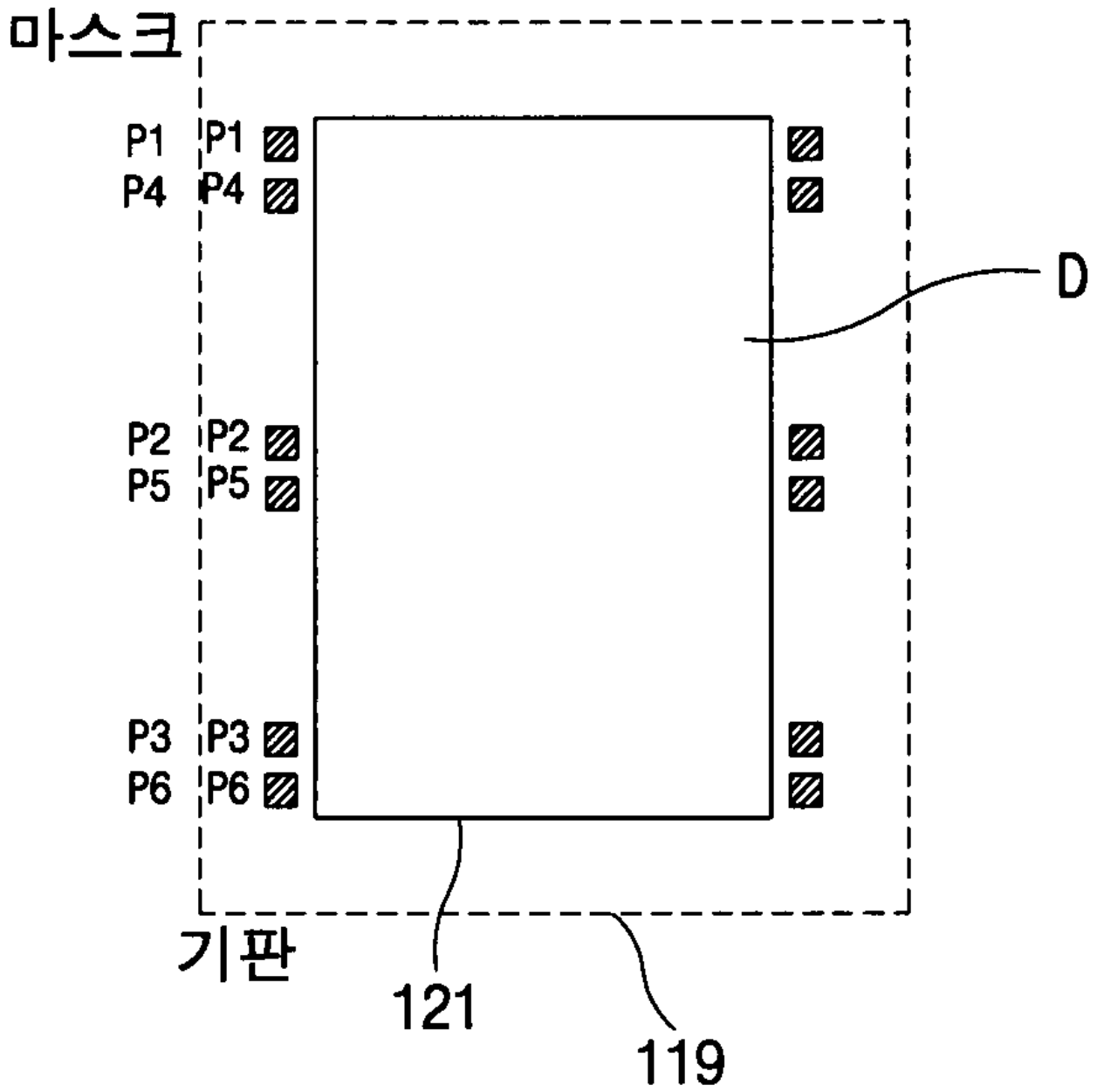
6b



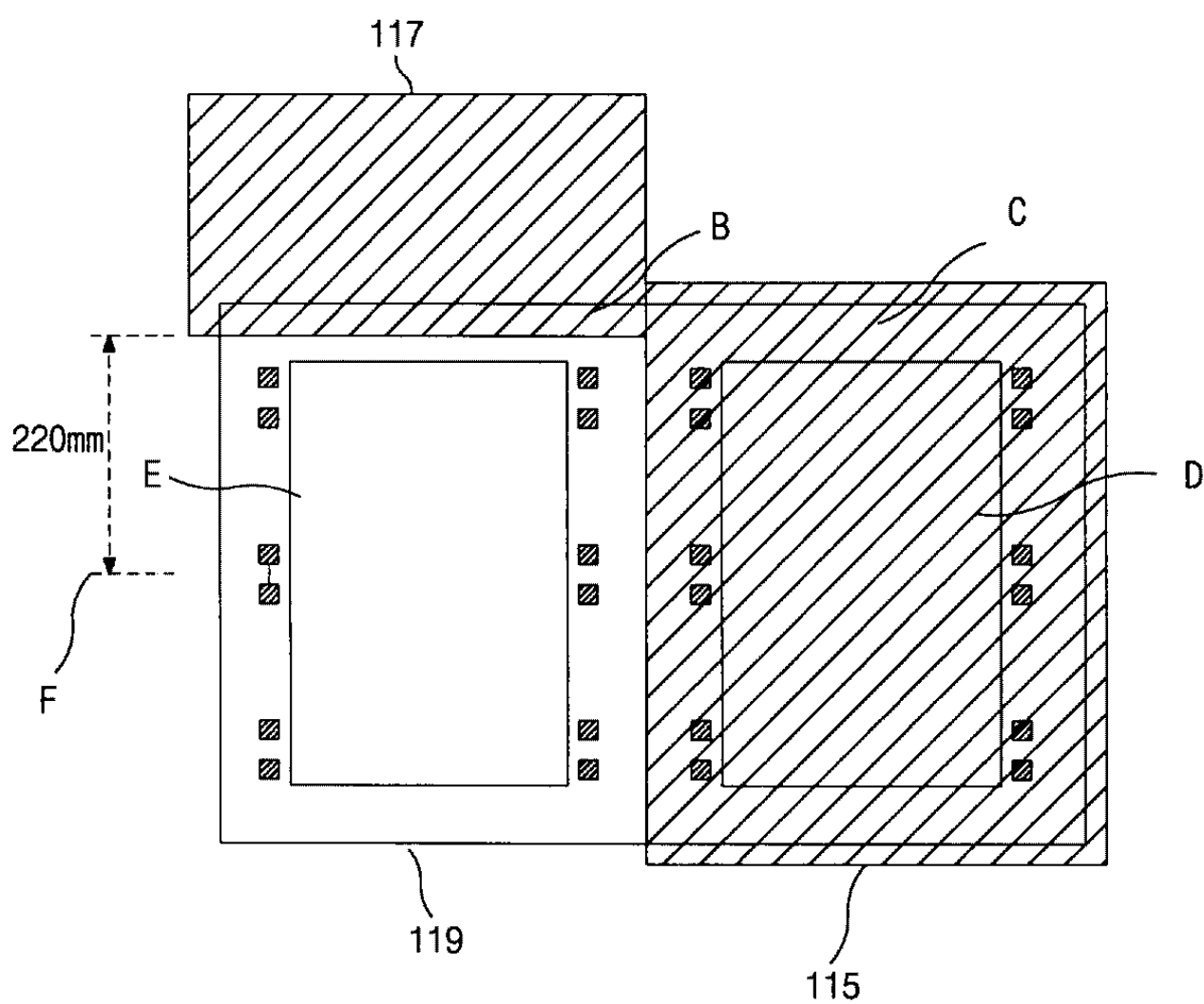
7a



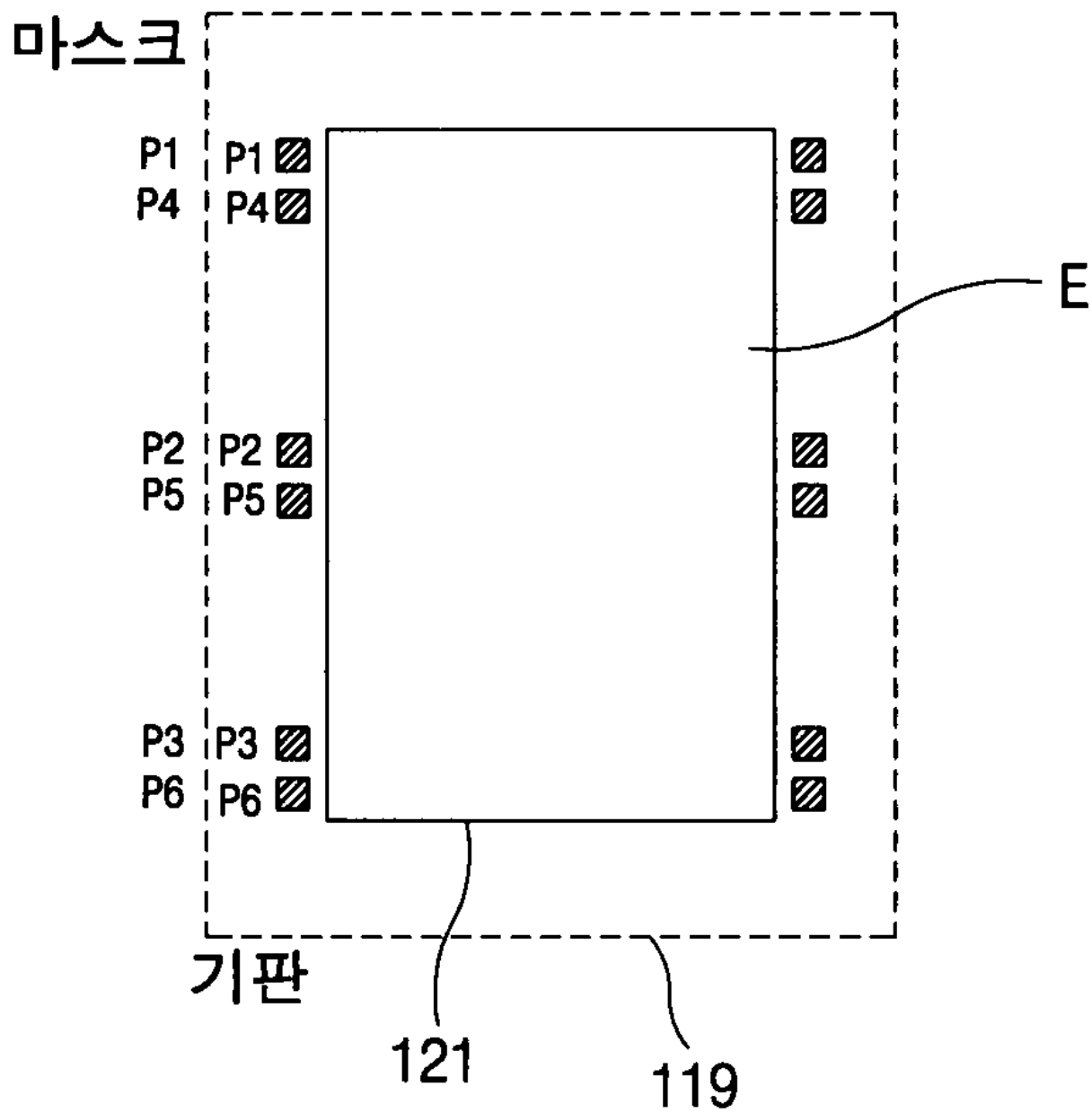
7b



8a



8b



专利名称(译)	用于大面积液晶显示器的光掩模和阵列基板制造方法		
公开(公告)号	KR1020010083632A	公开(公告)日	2001-09-01
申请号	KR1020000007614	申请日	2000-02-17
[标]申请(专利权)人(译)	乐金显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
[标]发明人	KIM JUNG YOUNG 김중영		
发明人	김중영		
IPC分类号	G02F1/13 G03F9/00 G02F G03F7/20		
CPC分类号	G03F9/7084 G03F7/70433 G03F7/70791		
其他公开文献	KR100611041B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

光掩模技术领域本发明涉及一种用于制造大面积液晶显示装置的阵列基板的光掩模，其中在光掩模上形成的对准标记上以预定间隔形成另一对准标记，以形成面积为590mm×670mm的基板。可以制造20英寸或更大的大面积阵列基板。 4

